

Interview with Mr. Yamamoto, CEO of EVG JapanFY2021 Orders Reach Record High. Supporting Customers with NIL and Contract Manufacturing. – December 9, 2021



客支援サービ

NIL

スも始めまし

テップ&リビ

山本 8月

から教えて下さい。

1面の続き

## インタビュー EVGジャパン

## 山本代表に聞く

カー各社からの引き合いが 来ていることも挙げられ 料開発に向けて、材料メー としてはNIL向けの新材 今の高成長につながってい ってきたものが、続々と量 期)における全社ベースで 調だ。最近の目立った動き フィー (NIL) などが好 る。分野別では引き続き 産に移行していることが昨 り、受注高としては過去最 台後半の伸びを見せてお の受注高は前年度比で1桁 れまで開発案件から携わ 三体の8割を占めており 型記録した。 量産用途が **ノインプリントリングラ** 

## 21年度受注高は過去最高 NIL 受託製造で顧客支援

タンプの受託製造を行うも タンプ作製のための大面積 録することができた。20年 は、全社ベースと同様に受 い。我々がその部分をサポ のだ。マスターテンプレー とを発表した。これは最新 グショップ」を設立したこ MEMS関連が全体の5割 常に多かったが、21年度は 度はNIL関連の受注が非 注金額として前年度比1桁 を下げていきたいと考えて 高額で顧客の投資負担も重 マスターテンプレートとス の当社製装置とクリーンル **弾を占めるなど、ユニーク** 台後半の伸びを21年度に記 ト向けの製造装置は非常に レプロセス用ワーキングス 山本 日本法人において トすることで、参入障壁 ム施設を活用して、NI 国内ビジネスの状況 討されており、当社のウエ リケーションが増えていま とデボンダーが受注の主軸 リアとなっている。 ーションであったが、近年 香石った。 具体的には、CFETやB する期待が高まっている。 のでもウエハー接合を採用 界的に非常に大きな事業工 表される先端パッケージン ている。チップレットや2 エハー接合のニーズが増し はプロセスの微細化やスケ エハー接合の主なアプリケ EOL新構造での採用が検 MOSスケーリングそのも グ分野がそれに該当し、世 D、イメージセンサーがウ ・5/30パッケージに代 ーリングを補つ目的で、ウ 近年はそれに加えて、C 山本 MEMSやLE 接合装置のうち、 ウエハー接合のアプ

ている。

―22年度の事業目標

提案を紹介できればと考え

げていくのかに焦点を当てな発想でデバイスを作り上

クショップ」を設立したこ った。製品別ではボンダー ―セミコン・ジャパンート(S&R)マスタリン に占めるウエートは大きか ている。 これに続くかたちで、全体 採用を想定した設計となっート(S&R)マスタリン に占めるウエートは大きか ている。 また、化合物ウエハー関 ONDSCALE」などは、

2021にも出展します。

今年のコンセプトについ

3

クな転換期を迎えた半導体

業界に対して、いかに自由

をテーマに、ドラスティッ